

## イオンサイザー EM-09100IS

製造元	日本電子株式会社
仕様	使用ガス： アルゴン 加速電圧： 1～8 kV
保有部署	材料工学専攻
設置場所	吉田・工学部物理系校舎・1階 118室
利用期間・時間、 利用料金	本設備の共同利用規程を参照 <a href="https://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/research/yui/naiki/20210210-zaiko">https://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/research/yui/naiki/20210210-zaiko</a>
注意事項等	
連絡先	材料工学専攻 教育研究支援室 技術職員 鹿住健司 075-753-5474 <a href="mailto:kazumi.kenji.6r@kyoto-u.ac.jp">kazumi.kenji.6r@kyoto-u.ac.jp</a>
キーワード	イオンミリング、試料作製、断面ミリング、CP、TEM、SEM
機器コード	0000103011
自由記入欄	アルゴンイオンビームを試料に照射し表面の原子を弾き飛ばして試料を削ることで、TEM（透過電子顕微鏡）観察が可能な薄膜試料を作製できるイオンミリング装置である。本装置を用いる前の工程として機械研磨を行う必要があるが、他のイオンミリング装置よりも簡易な機械研磨でよい。クロスセクションポリッシャ（SEM観察のための断面ミリング装置）として使うこともできる。

